552,677

## (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



## 

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 21. Oktober 2004 (21.10.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/091264 A2

(51) Internationale Patentklassifikation7:

\_\_\_\_

H<sub>0</sub>5H

- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/003796
- (22) Internationales Anmeldedatum:

8. April 2004 (08.04.2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 103 17 027.8 11. April 2003 (11.04.2003) Di

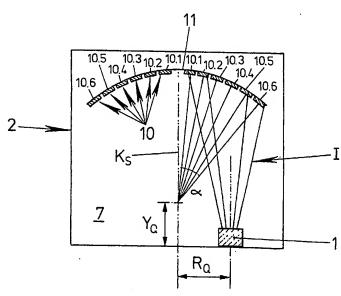
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): LEYBOLD OPTICS GMBH [DE/DE]; Siemensstrasse 86, 63755 Alzenau (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BECKMANN, Rudolf [DE/DE]; Am Katzengraben 35, 63546 Hammersbach (DE).
- (74) Anwalt: POHLMANN, Bernd, Michael; Reinhardt & Pohlmann Partnerschaft, Günthersburgallee 40, 60316 Frankfurt am Main (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: HIGH FREQUENCY PLASMA JET SOURCE AND METHOD FOR IRRADIATING A SURFACE
- (54) Bezeichnung: HOCHFREQUENZ-PLASMASTRAHLQUELLE UND VERFAHREN ZUM BESTRAHLEN EINER OBER-FLÄCHE



(57) Abstract: The invention relates to a high frequency plasma jet source (1) comprising a space (3) for accommodating a plasma, electrical means (8, 9) for applying a voltage to said high frequency plasma jet source (1) so as to ignite and obtain the plasma, means (4) for extracting a plasma jet (I) from the plasma space (3), and an outlet port which is separated from the vacuum chamber (7) by means of an extraction grid (4). The plasma jet (I) emerges from the high frequency plasma jet source (1) with essentially divergent radiation characteristics. The invention further relates to a method for irradiating a surface with a plasma jet (I) of a high frequency plasma jet source, said plasma jet (I) being divergent.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

